



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110692147 A

(43)申请公布日 2020.01.14

(21)申请号 201780091437.2

(22)申请日 2017.12.13

(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2019.11.29

(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/CN2017/116005 2017.12.13

(87)PCT国际申请的公布数据
W02019/113852 ZH 2019.06.20

(71)申请人 深圳市柔宇科技有限公司
地址 518172 广东省深圳市龙岗区横岗街
道龙岗大道8288号大运软件小镇43栋

(72)发明人 廖志富

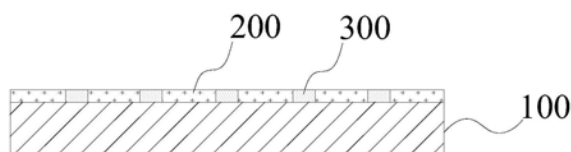
(51)Int.Cl.
H01L 51/56(2006.01)
G23C 14/04(2006.01)

(54)发明名称

用于真空蒸镀的掩膜板、蒸镀方法、显示装置及蒸镀设备

(57)摘要

用于真空蒸发镀膜掩膜板、利用掩膜板进行蒸镀的方法、有机发光显示装置以及利用掩膜板进行蒸镀的设备。该掩膜板包括：衬底(100)；反射层(200)，反射层(200)设置在衬底(100)上，反射层(200)上具有镂空区域；吸热层(300)，吸热层(300)设置在衬底(100)具有反射层(200)的一侧且覆盖镂空区域。



专利名称(译)	用于真空蒸镀的掩膜板、蒸镀方法、显示装置及蒸镀设备		
公开(公告)号	CN110692147A	公开(公告)日	2020-01-14
申请号	CN201780091437.2	申请日	2017-12-13
[标]申请(专利权)人(译)	深圳市柔宇科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	深圳市柔宇科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	深圳市柔宇科技有限公司		
[标]发明人	廖志富		
发明人	廖志富		
IPC分类号	H01L51/56 C23C14/04		
CPC分类号	C23C14/04 H01L51/56		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

用于真空蒸发镀膜掩膜板、利用掩膜板进行蒸镀的方法、有机发光显示装置以及利用掩膜板进行蒸镀的设备。该掩膜板包括：衬底(100)；反射层(200)，反射层(200)设置在衬底(100)上，反射层(200)上具有镂空区域；吸热层(300)，吸热层(300)设置在衬底(100)具有反射层(200)的一侧且覆盖镂空区域。

